



2017年6月7日（水）実施

● 13時20分～15時20分 ～座学～

X線ミラーとX線レンズを使ったアプリケーションのご紹介～測定方法～

- θ - 2θ 測定
 - 定性分析
 - 配向方位の評価
- 微小角入射(2θ)測定
 - 薄膜の定性分析
- X線反射率測定
 - 薄膜の膜厚、密度、膜厚評価
- 残留応力測定
 - 格子定数変化から残留応力評価
- 極点図測定
 - 配向方位の評価
- ご質問など

● 15時20分～17時 ～実習～

X線反射率測定・解析の実習

- X線反射率測定・解析の実習内容
 - 測定膜厚範囲について
 - 使用光学系の選択と設定方法
 - 2θ 原点の設定方法
 - 試料のアライメント方法（高さ、煽り角、入射角）
 - 測定プログラムの作成方法
 - X' Pert Reflectivity ソフトウェアの使用方法（シミュレーション、フィッティング）
 - ご質問、リクエストなど